

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 3 区分
 【発行日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【公開番号】特開2001-217647(P2001-217647A)
 【公開日】平成13年8月10日(2001.8.10)
 【出願番号】特願2001-22575(P2001-22575)
 【国際特許分類】

H 0 3 B 5/18 (2006.01)

【 F I 】

H 0 3 B 5/18 C

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 スタブ調整可能素子の調整依存量を調整する方法であって、前記スタブ調整可能素子に関しての所望の調整依存量を選択するステップと、調整スタブの 2 つの導電性ランナを、前記調整スタブに沿う第 1 の位置で、電氣的に短絡するステップと、

前記スタブ調整可能素子を試験して、前記調整依存量を決定するステップと、

前記スタブ調整可能素子に関しての前記所望の調整依存量を生成するために、短絡部が位置付けされるべき前記調整スタブに沿う第 2 の位置を決定するステップと、

自動位置決め装置を用いて、前記調整スタブに沿う前記第 2 の位置で前記調整スタブの前記 2 つの導電性ランナを電氣的に短絡するステップとを含む方法。

【請求項 2】 前記調整スタブに沿う第 1 の位置で調整スタブの 2 つの導電性ランナを電氣的に短絡する前記ステップは、自動位置決め装置を用いて、前記 2 つの導電性ランナを短絡するステップを含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 自動位置決め装置を用いる前記ステップは、ワイヤをワイヤ接着して、前記 2 つの導電性ランナを電氣的に短絡するステップを含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】 前記調整スタブに沿う前記第 1 の位置で電氣的な前記短絡を解消するステップを更に含んでいる請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】 前記決定ステップが、前記第 1 の位置からの移動量として前記第 2 の位置を決定する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】 前記決定ステップが、自動位置決め装置に対する既知の基準に対応して前記第 2 の位置を決定するステップを含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 7】 前記スタブ調整可能素子が発振器である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 8】 前記調整依存量が周波数である、請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】 請求項 1 に記載のプロセスで製造された製品。

【請求項 10】 スタブ調整可能素子を調整する方法であって、前記スタブ調整可能素子に関しての所望の調整依存量を選択するステップと、調整スタブの 2 つの導電性ランナを、前記調整スタブに沿う第 1 の位置で電氣的に短絡するステップと、

前記スタブ調整可能素子を試験して、前記調整依存量を決定するステップと、

前記スタブ調整可能素子に関しての前記所望の調整依存量を生成するために、短絡部を位置付けされるべき前記調整スタブに沿う第 2 の位置を決定するステップと

前記導電性ランナに沿って、前記第 1 の位置の近接した、所定数の可能性のある第 2 のスタブ短絡位置を定めるステップと、

前記第 2 の位置として前記所定数の可能性のある第 2 のスタブ短絡位置のうちの 1 つを選択するステップと、

自動位置決め装置を用いて、前記調整スタブに沿う前記第 2 の位置で前記調整スタブの前記 2 つの導電性ランナを電氣的に短絡するステップとを含む前記方法。

【請求項 1 1】 前記第 1 の位置の近くに前記所定数の可能性のあるスタブ短絡位置を定めるステップが、前記導電性ランナに沿って等しい間隔で前記所定数の可能性のあるスタブ短絡位置を定めるステップを含む請求項 1 0 に記載の方法。

【請求項 1 2】 前記第 1 の位置の近くに前記所定数の可能性のある第 2 のスタブ短絡位置を定めるステップが、前記第 1 の位置に関して可能性のある第 2 のスタブ短絡位置を基準にして非対称の分布を定めるステップを含む請求項 1 0 に記載の方法。

【請求項 1 3】 前記第 1 の位置の近くに前記所定数の可能性のある第 2 のスタブ短絡位置を定めるステップが、前記第 1 の位置に関して可能性のある第 2 のスタブ短絡位置を基準にして対称の分布を定めるステップを含む請求項 1 0 に記載の方法。

【請求項 1 4】 スタブ調整可能素子を調整する装置であって、

前記スタブ調整可能素子が製作される基板を受けるワイヤ・ボンダと、

独自の基板識別子を決定する検出器と、

複数のスタブ調整可能素子の調整依存量を維持するホスト・プロセッサに結合できるデータベースであって、特殊な独自の識別子によって識別された基板上のスタブ調整可能素子の前記調整依存量を得るために、前記ホスト・プロセッサがアクセスできる、データベースと、

前記ワイヤ・ボンダに及びそれと通信する前記検出器とに結合されたホスト・プロセッサであって、第 2 のスタブ短絡が前記スタブ調整可能素子の前記調整依存量を微調整するために生じなければならない、所定数の可能性のある第 2 のスタブ短絡位置のなかの何れか 1 つを識別できて、前記ワイヤ・ボンダは前記所定数の可能性のある第 2 のスタブ短絡位置のなかで識別されたものを前記ホスト・プロセッサから受けるように適応されていて、前記ワイヤ・ボンダがそこで第 2 のスタブ短絡を固定できる、ホスト・プロセッサとを含む装置。

【請求項 1 5】 前記検出器がカメラである、請求項 1 4 に記載の装置。